MATRICE DE RESISTANCES ADRESSABLES INDEPENDAMMENT, ET SON PROCEDE DE REALISATION

DESCRIPTION

5 DOMAINE TECHNIQUE

10

L'invention se rapporte aux matrices de composants passifs, plus particulièrement aux résistances connectées entre elles par des lignes et des colonnes, ainsi qu'à leur fabrication. Ces matrices de résistances peuvent être utilisées dans différents domaines, notamment pour activer des composants par veffet Joule.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Pour gagner en place et en densité de 15 commandes, les matrices de résistances ont été développées où un nombre important d'éléments résistifs sont condensés sur une petite surface, tout en étant activables individuellement.

Comme le montre la figure 1, une matrice de 20 résistances comporte N lignes de commandes (indicées Ni, avec i entier strictement positif), M colonnes de commande (indicées M₁, avec j entier strictement positif), et NM résistances (indicées Rii, chaque résistance Rij étant commandée par la ligne Ni et la 25 colonne M_i). Pour commander une résistance, « ferme » les interrupteurs de ses ligne et colonne : on peut par exemple appliquer la tension « +V » sur la ligne N_i et « 0 » sur la colonne M_j ; la résistance R_{ij} est alors « adressée », c'est-à-dire soumise à un 30 courant, contrairement aux autres.

2

Quelle que soit l'utilisation de ces matrices, un des enjeux est de localiser précisément la

puissance de commande sur une résistance déterminée afin d'atteindre l'effet escompté par la commande, tout en limitant la puissance dissipée dans les autres

éléments de la matrice, notamment les résistances, du fait des courants induits ou dérivés, tant pour

augmenter la puissance dans la résistance adressée que

pour que la commande reste spécifique.

5

10

15

20

25

30

En effet, le maximum de puissance est dissipé dans la résistance adressée. Cependant, il existe également des autres courants non nuls circulant dans les lignes et colonnes, ainsi que dans les autres résistances, qui eux aussi induisent des pertes de puissance dans et par ces éléments. Ceci entraîne que la puissance de commande n'est pas totalement dissipée dans la résistance adressée (perte d'efficacité) et que les résistances non adressées dissipent elles aussi une puissance non désirable (perte de sensibilité). Des simulations ont ainsi montré que pour une matrice de 150 points par exemple, environ 15 % de la puissance est dissipée au point adressé, alors que les autres points où la puissance dissipée est la plus forte dégagent environ 5 % de la puissance.

Un des moyens connus pour remédier à ces effets est de coupler chaque résistance à une diode ou un interrupteur pour bloquer le courant dans les résistances non adressées. Cependant, cette solution est très lourde car elle implique de doubler chaque résistance, ce qui entraîne des coûts de fabrication et une perte de compacité préjudiciables.

Une autre technique serait de segmenter la matrice en sous unités telles que la perte de puissance est réduite, ce qui permet de réduire le nombre de diodes. Cette solution n'élimine pas les problèmes de complexité inhérents aux diodes, ni l'échauffement parasite résiduel dans chacune des matrices.

3

Une autre alternative consiste à commander chaque ligne et colonne avec des tensions qui sont ajustées et asservies par un système de contrôle. Par intermédiaire, il est possible de contrôler précisément la puissance résiduelle dans les résistances non adressées et de modifier paramètres. Si cette solution est performante, il est clair qu'elle nécessite un système de contrôle de commande coûteux et complexe à mettre en œuvre.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

5

10

. 15

20

L'objet de l'invention est de proposer une solution simple, qui évite les inconvénients inhérents aux solutions existantes, pour la réalisation d'une matrice de résistances permettant de localiser de la puissance sur une des résistances de la matrice en limitant la puissance dissipée dans le reste de la matrice. Thermiquement, cette résistance active un composant associé.

Plus particulièrement, l'un des aspects de l'invention concerne le choix des propriétés thermiques d'au moins une résistance, afin d'augmenter son rendement d'adressage, c'est-à-dire la puissance dissipée par cette résistance par rapport à la puissance totale dissipée, puissance permettant d'activer thermiquement un composant associé. Cette

4

résistance (ou ces résistances) est ainsi choisie à coefficient de température négatif, c'est-à-dire que la valeur de la résistance diminue avec sa température. Au cours de son utilisation, par le dégagement puissance, la température de l'élément résistant augmente; selon l'invention, la valeur de sa résistance va alors diminuer, et donc sa puissance à tension augmenter constante au cours l'échauffement. La précision de l'activation composants associés est ainsi accrue.

5

10

15

L'invention se rapporte ainsi à une matrice de résistances dont l'une des résistances est à coefficient de température négatif et associée à un composant activable thermiquement. Avantageusement, ces résistances à coefficient de température négatif sont constituées d'un matériau unique possédant cette propriété, ce qui simplifie d'autant le processus de fabrication.

Un exemple de réalisation préféré concerne 20 une matrice dont toutes les résistances sont coefficient de température négatif, et notamment identiques. En effet, quelle que soit la matrice, la puissance dégagée dans les résistances non adressées inférieure à la puissance dissipée au point 25 adressé. La température de la résistance adressée augmente donc plus vite que la température du reste du circuit : même si toutes les résistances sont coefficient de température négatif, voire identiques, la valeur des résistances non adressées diminuera moins 30 vite au cours du temps que celle de la résistance adressée. Un phénomène d'augmentation de la puissance

5

dégagée par les résistances non adressées se produit, mais inférieur à l'augmentation de la puissance dissipée par la résistance adressée. On observe donc également dans ce cas un gain en rendement par rapport à celui réalisé dans une matrice classique.

Avantageusement, le matériau utilisé pour certaines des lignes et colonnes, voire toutes, possède un coefficient de température positif, ce qui entraîne une augmentation de la résistance de ces éléments et donc une diminution de puissance perdue.

Plusieurs résistances de la matrice selon l'invention, voir toutes, peuvent être couplées à des composants pour les activer. L'invention se rapporte également à un dispositif utilisant cette matrice, tel une biopuce ou une carte réactionnelle.

Avantageusement, pour optimiser son rendement, il est possible d'ajuster, par exemple par un générateur d'impulsions programmable, le temps d'application de la tension de commande sur une résistance.

L'invention se rapporte également au procédé de fabrication d'une matrice de résistances dont une résistance, associée à un composant activable thermiquement, est formée d'un matériau mis en place, par exemple par dépôt, sur un substrat, le matériau possédant une résistance à coefficient de température négatif.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

5

10

15

20

25

L'invention sera mieux comprise au moyen 30 des figures suivantes, qui servent uniquement à

15

illustrer l'invention et ne sont nullement restrictives :

FIG.1: schéma d'une matrice de résistances, avec indication d'un courant induit.

FIG.2: évolution par rapport au temps de différents paramètres en cours d'utilisation d'une matrice de résistances à coefficient de température positif (FIG.2a) et d'une matrice de résistances à coefficient de température négatif (FIG.2b).

10 FIG.3: synopsis d'un exemple de fabrication d'une matrice préférée selon l'invention.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

Ainsi que décrit précédemment, la figure 1 représente une matrice classique de résistances adressables séparément comprenant N lignes, M colonnes et NM résistances. Ces résistances peuvent être commandées soit simultanément, soit successivement, soit encore selon une combinaison de ces deux modes.

La résistance R₁₁ est adressée, et dissipe

20 une puissance $P_{ij}: P_{ij} = \frac{U^2}{R_{ij}}$, avec U tension aux bornes.

La puissance P_{ij} peut notamment être utilisée pour activer thermiquement un composant associé à la résistance R_{ij} .

Le rendement Q_{ij} de la résistance R_{ij}
25 adressée est égal à la puissance P_{ij} rapportée à la
puissance totale dégagée. Or, les autres éléments de la
matrice réagissent eux aussi à la tension d'adressage :
un exemple de courant induit est ainsi représenté en
pointillés, qui entraîne dans cette configuration un

dégagement de puissance notamment par les résistances R_{i+1} , R_{i+1} , ainsi que par les segments de lignes et colonnes les séparant. Ces paramètres sont

7

toute dissipation de ailleurs, 5 Par s'accompagne d'un échauffement de la puissance de d'une élévation sa concernée et résistance température. La température de la résistance adressée augmente plus et plus vite que celle des 10 éléments.

à prendre en compte pour l'évaluation du rendement.

Or les matériaux classiques pour fabriquer résistance augmenter leur résistances voient des lorsque la température augmente : voir la courbe Rij de la figure 2a. La puissance dissipée (courbe Pij) par la résistance Rij va donc diminuer au cours du temps, et ce plus rapidement que la puissance dégagée par les autres la température et la résistance résistances, dont (courbe $R_{\text{na}})$ augmentent moins vite. Le rendement de la résistance Rij adressée diminue donc au fur et à mesure de son activation (courbe Q_{ij}), et l'augmentation de température, qui est l'objectif souhaité dans le cadre des matrices de commande pour chauffage par effet Joule des éléments, ralentit.

15

20

Dans le cadre de l'invention, on utilise

25 pour fabriquer la résistance R_{ij} un matériau dont la
résistance diminue avec la température, c'est-à-dire
une résistance à coefficient de température négatif, ou
NTCR (« Negative Thermal Coefficient Resistance »). Ce
matériau peut être l'un des composants de la résistance

30 ou la résistance peut être fabriquée entièrement d'un
tel matériau. Des exemples en sont le Nitrure de

8

Tantale, des alliages Nickel-Chrome, ou des nitrures de matériaux réfractaires. Le coefficient de température (TCR) peut être ajusté, soit par la combinaison de matériaux, soit par les paramètres choisis lors de la fabrication de la résistance. Selon les besoins, le NTCR peut ainsi varier de -100 à -3000 ppm/°C.

5

10

15

20

25

30

Dans ce cas d'une matrice de NTCR illustré par la figure 2b, au cours du temps, la dissipation d'énergie par la résistance adressée R_{ij} augmente ainsi que sa température, sa résistance (courbe R_{ij}) diminue, et donc sa puissance dissipée (courbe P_{ij}) augmente d'autant plus.

On constate aussi sur la figure 2b que, dans ce cas où toutes les résistances sont des NTCR, les autres résistances à coefficient de température négatif qui ne sont pas adressées voient également leur résistance diminuer (courbe R_{na}), mais de façon moindre car leur température évolue moins vite, la puissance dégagée par elles restant inférieure à la puissance dissipée P_{ij} . Le rendement de la résistance adressée (courbe Q_{ij}) augmente donc.

Une combinaison des deux exemples est envisageable, où la résistance adressée R_{ij} est à coefficient de température négatif, et les autres R_{na} à coefficient de température positif : on constaterait alors que le rendement Q_{ij} du point adressé augmente d'autant plus (non illustré), et notamment dans des proportions plus grandes encore que dans le cas d'une matrice totalement NTCR. D'autres combinaisons sont envisageables, avec par exemple une ligne et/ou une colonne NTCR seulement.

9

Par ailleurs, la résistance R_{ij} est adressée par une puissance de commande qui détermine la tension U aux bornes et la puissance P_{ij} dissipée par cette résistance.

Un facteur de modulation de P_{ij} autre que la valeur de chaque résistance est donc la puissance « réellement » adressée à R_{ij}. Cette puissance est inférieure à la puissance de commande initiale, avec des pertes partielles dans les autres résistances tel que décrit plus haut, mais également des pertes reliées à la résistance intrinsèque des lignes et des colonnes.

Il peut donc être avantageux d'utiliser un matériau à TCR positif, tel l'aluminium ou le cuivre, pour ces lignes et colonnes : par conduction thermique depuis la résistance chauffée, le matériau utilisé dans les lignes et colonnes est susceptible de chauffer. Grâce à l'utilisation d'un matériau à TCR positif pour ces lignes et colonnes, la résistance des lignes et colonnes va alors augmenter, et la puissance perdue dans celles-ci va diminuer, augmentant d'autant la puissance adressée, et par là même le rendement de la résistance adressée.

15

20

25

30

La puissance adressée, et donc la tension aux bornes de la résistance adressée, peuvent également être modulées lors de l'utilisation par ajustement de la durée d'application de cette tension. Ce dernier paramètre temporel permet d'optimiser le rendement souhaité pour chaque résistance R_{ij} adressée, et la température souhaitée pour activer le composant concerné par cette résistance. En effet, le processus permettant le chauffage par effet Joule est un

10

phénomène dynamique. Ainsi, l'application d'une tension pendant une durée courte, par exemple 0,2 s, permettra d'obtenir des élévations de température modérées, l'ordre de 100°C, et l'application de la commande pendant une durée plus longue, par exemple 10 entraînera des températures plus élevées, de l'ordre de 2b). A titre d'exemple 500°C figure (voir représenté dans la figure 1 un générateur d'impulsions relié aux lignes et colonnes, qui d'appliquer des tensions déterminées en amplitude et en durée aux bornes desdites lignes (N) et colonnes.

Exemple 1

5

10

15

Soit un réseau de 144 résistances adressées par 12 lignes et 12 colonnes, avec des résistances chauffantes à adresser de 1000 ohms et une résistance inter lignes et inter colonnes de 1 ohm, c'est-à-dire une résistance intrinsèque de 1 ohm de chaque ligne et/ou colonne d'interconnexion.

Par simulation, on a trouvé que pour des 20 résistances à coefficient de température nul, la puissance dissipée au point adressé est de 15 % de la puissance totale dissipée dans le réseau, et que la puissance maximale dégagée par les autres résistances est de 4,5 %.

Si les résistances ont un TCR de -2500 ppm/°C, lorsque la température de la résistance adressée atteint 300°C, les autres résistances ont au maximum atteint 100°C, et la puissance dissipée par la résistance adressée atteint 40 % de la puissance totale au lieu de 15 %, c'est-à-dire qu'elle a plus que doublé.

11

La matrice selon l'invention permet donc d'obtenir des températures très élevées, de 500°C et plus, en des points très localisés, pour des matrices qui permettent d'adresser de nombreux points (50 jusque 1000 et plus), et ce de façon rapide. Un ajustement de la puissance maximale nécessaire est possible en contrôlant la valeur du TCR des résistances. Ces effets sont de plus possibles sans dispositif de diodes ou d'interrupteurs pour alourdir le système, et la matrice peut être réalisée sur différents types de substrats, par l'intermédiaire de méthodes de fabrication évitant les technologies lourdes.

5

10

15

20

25

.3.0

En effet, pour réaliser une matrice selon technologies standard de la des l'invention, impliquant notamment microélectronique, dépôt photolithogravure, sont utilisées de façon préférée. Cependant, toute autre technique utilisable pour la microsystèmes est envisageable: fabrication de sérigraphie de colles, adhésifs, polymères conducteurs ou non, pâtes de sérigraphie, technologie de jet d'encre,...

figure 3 représente un exemple La (10) de fabrication : un substrat procédé silicium est choisi. Une couche d'aluminium (12) est pulvérisation cathodique (FIG.3a). déposée par Photolithographie et gravure chimique permettent d'obtenir des motifs lignes (14) (FIG.3b). Une couche matériau résistif NTCR (16) est déposée par cathodique (FIG.3c) ; les pulvérisation résistifs (18) sont obtenus par photolithographie et gravure (FIG.3d). Une couche diélectrique (20) est

12

ensuite déposée pour isoler lignes (14) et colonnes (FIG.3e), avec photolithographie des motifs de reprise de contact (22) sur les colonnes (FIG.3f). Enfin, une couche d'aluminium (12) est déposée par pulvérisation cathodique (FIG.3g), les motifs colonnes (24) étant réalisés par photolithographie et gravure (FIG.3h). Les composés activables thermiquement sont associés selon les techniques connues.

Typiquement, la couche d'aluminium (12) a une épaisseur de 500 à 50000 Å, de préférence 5000; l'épaisseur de NTCR (16) est typiquement comprise entre 500 à 5000 Å, de préférence 1000. Le NTCR peut être ajusté de préférence entre -100 et -3000 ppm/°C suivant les conditions de dépôt et les paramètres d'utilisation recherchés.

Comme isolant diélectrique (20), on peut utiliser un polymère ou un minéral tel SiO_2 ou Si_3N_4 . Le substrat (10) est isolant et comprend par exemple du silicium, un polymère, un verre, une céramique, etc., ou encore une combinaison de ces matériaux.

Application

20

25

30

Les matrices selon l'invention trouvent leur application dans de nombreux domaines, comme par exemple la biologie, l'imagerie ou les écrans plats, où les systèmes de commande doivent être miniaturisés. Plus particulièrement, les matrices selon l'invention peuvent être utilisées pour fabriquer des biopuces ou encore des « Lab On Chip », appelés aussi cartes réactionnelles. Une telle carte réactionnelle est connue par exemple du document WO 02/18823. De façon générale, on appellera par la suite dispositif à usage

13

biologique toute structure apte à être utilisée dans des applications en biologie, comme par exemple les cartes réactionnelles ou les biopuces.

pour réaliser de tels Cependant, 5 dispositifs à usage biologique, un réseau micro fluidique est intégré sur la carte de support du dispositif: le liquide à analyser doit circuler par exemple entre les différents réactifs. Afin de faire circuler un liquide dans un réseau de micro canaux, on actionne des micro-vannes. 10

Des micro-vannes ont été développées pour des applications dans des microsystèmes, des biopuces et des cartes réactionnelles. Un exemple en est donné dans le document FR-A-2 828 244, qui concerne des micro-vannes actionnées par effet pyrotechnique. La mise en route des micro-vannes demande de réaliser un chauffage localisé en dessous du microsystème, par exemple par l'échauffement d'une résistance sous chaque micro-vanne qui sera alors actionnée par effet Joule.

15

30

Pour cette application préférée, le réseau de micro-vannes doit être conséquent, avec une densité importante de ces composants à activer : par exemple 50 à 1000 micro-vannes sur une surface typiquement de l'ordre de la taille d'une carte de crédit doivent être adressées séparément. L'utilisation de matrices de résistances semble donc toute indiquée.

Les matrices selon l'invention ajoutent comme avantage l'optimisation du rendement de chaque adressage, et donc une meilleure efficacité et spécificité des analyses effectuées.

WO 2005/034148

REVENDICATIONS

- 1. Matrice de résistances comportant N lignes de commandes N_i, avec i entier strictement positif, M colonnes de commande M_j, avec j entier strictement positif, et NM résistances R_{ij}, chaque résistance R_{ij} étant commandée par la ligne N_i et la colonne M_j, caractérisée par le fait qu'au moins une des résistances est à coefficient de température négatif et est associée à un composant activable thermiquement.
- 2. Matrice selon la revendication 1 caractérisée en ce que chaque résistance R_{ij} est 15 associée à un composant activable thermiquement.
 - 3. Matrice selon l'une des revendications 1 ou 2 dont au moins un des composants activables est une micro-vanne.

20

- 4. Matrice selon l'une des revendications 1 à 3 dont toutes les résistances R_{ij} sont à coefficient de température négatif.
- 5. Matrice selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisée en ce que au moins une des résistances à coefficient de température négatif est constituée d'un seul matériau.
- 30 6. Matrice selon la revendication 4 caractérisée en ce que toutes les résistances à

WO 2005/034148

coefficient de température négatif sont constituées d'un seul matériau.

- 7. Matrice selon l'une des revendications 1 à 6 caractérisée en ce que toutes les résistances sont identiques.
- 8. Matrice selon l'une des revendications précédentes dont la résistance à coefficient de 10 température négatif comprend du Nitrure de Tantale, un alliage Nickel-Chrome ou un nitrure de matériau réfractaire.
- 9. Matrice selon l'une des revendications 15 précédentes dont la résistance à coefficient de température négatif a un coefficient de température compris entre -100 et -3000 ppm/°C.
- 10. Matrice selon l'une quelconque des 20 revendications 1 à 9 caractérisée en ce que le matériau utilisé pour au moins une ligne et/ou au moins une colonne a une résistance à coefficient de température positif.
- 25 11. Matrice selon la revendication 10 caractérisée en ce que toutes les lignes et/ou toutes les colonnes sont composées d'un matériau à résistance à coefficient de température positif.
- 30 12. Matrice selon l'une des revendications 1 à 11 caractérisée en ce que toutes les

16

lignes et toutes les colonnes sont composées du même matériau.

- 13. Matrice selon l'une des 5 revendications 1 à 12 associée à un substrat isolant.
- 14. Matrice selon l'une des revendications précédentes comprenant en outre des moyens pour ajuster la durée d'application de la tension de commande sur au moins une des résistances R_{ij} pour en obtenir le rendement souhaité, en particulier sur chaque résistance R_{ij}.
- 15. Procédé de fabrication d'une 15 matrice de résistances dont l'une au moins résistances est obtenue par mise en place d'un matériau résistif (16) dont la résistance est à coefficient de température négatif sur un substrat (10) et comprenant l'association de cette résistance à un composant 20 activable thermiquement.
 - 16. Procédé de fabrication selon la revendication 15 comprenant la mise en place du matériau résistif par pulvérisation cathodique.

25

30

17. Procédé de fabrication selon l'une des revendications 15 ou 16 comprenant la mise en place d'un matériau conducteur (12) sur le substrat (10) pour former les lignes (14) avant la mise en place du matériau résistif.

17

18. Procédé de fabrication selon l'une des revendications 15 à 17 comprenant le dépôt d'un matériau conducteur (12) pour former les colonnes (24) après la mise en place du matériau résistif.

5

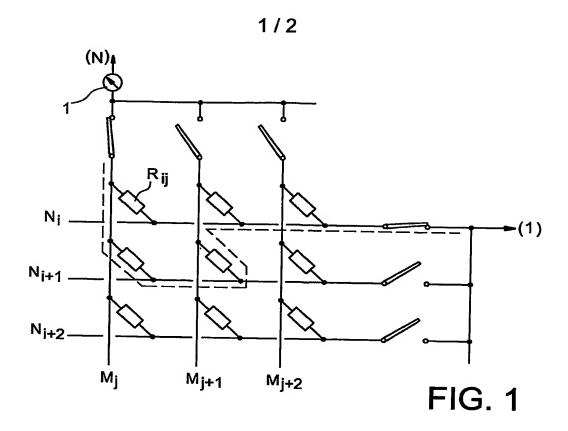
19. Procédé selon l'une des revendications 15 à 18 comprenant une étape de mise en place sur ledit substrat d'un matériau (20) isolant les lignes des colonnes.

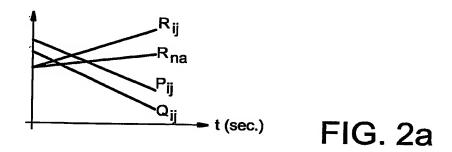
10

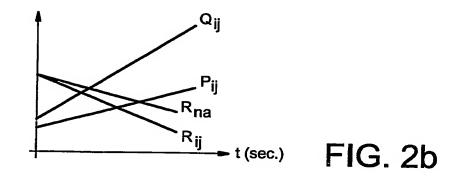
20. Procédé selon l'une des revendications 17 à 19 comprenant le choix d'un matériau dont la résistance est à coefficient de température positif pour les lignes et/ou colonnes.

15

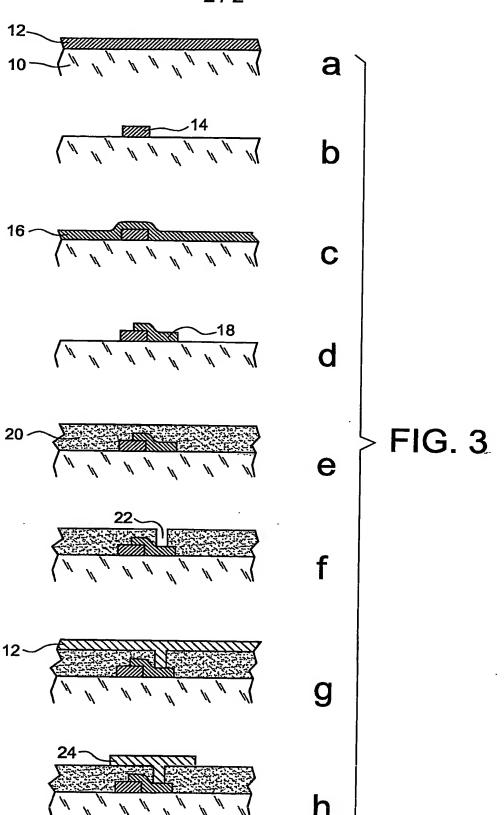
- 21. Procédé selon l'une des revendications 15 à 20 comprenant l'association de la matrice à un réseau de micro-vannes.
- 22. Dispositif à usage biologique comprenant une matrice selon l'une des revendications 1 à 14 associée à un réseau microfluidique.







2/2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation No PCT/FR2004/050476

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01C1/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C12Q G01N C12M B41J H01C G02B G02F B01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

EP 0 813 088 A (HEWLETT-PACKARD COMPANY) 17 December 1997 (1997-12-17)	1,2,4-6, 8,9, 12-15, 17-19
column 4, lines 14-20,52-59 column 5, lines 35-40 column 12, lines 4-11 column 20, lines 20-25	
EP 1 188 840 A (AGILENT TECHNOLOGIES, INC.) 20 March 2002 (2002-03-20) abstract paragraphs '0016!, '0017!, '0044!, '0045!	. 1
-/	
	17 December 1997 (1997-12-17) column 4, lines 14-20,52-59 column 5, lines 35-40 column 12, lines 4-11 column 20, lines 20-25 EP 1 188 840 A (AGILENT TECHNOLOGIES, INC.) 20 March 2002 (2002-03-20) abstract paragraphs '0016!, '0017!, '0044!, '0045!

Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.		
Special categories of cited documents: A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E* earlier document but published on or after the international filing date L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clied to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 "T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family 		
Date of the actual completion of the international search	Date of malling of the international search report		
7 March 2005	16/03/2005		
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer		
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Dessaux, C		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation No
PCT/FR2004/050476

C (Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/FR200	4/ 0504/ 0
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
	S. Section of the manageri, micro appropriate, or the relevant passages		1.0.070
A	US 2003/059807 A1 (WOLTER ANDREAS ET AL) 27 March 2003 (2003-03-27)		1
Α	paragraphs '0050!, '0074!, '0077!, '0078!, '0081!; claims 1,8,44,45; figures 7,8B the whole document		1–22
A	US 4 803 457 A (CHAPEL JR ROY W ET AL) 7 February 1989 (1989-02-07)		1
Α	7 February 1989 (1989-02-07) column 4, lines 40-68; claims 5,12		1–22
			·
	·		
•			
. <i>-</i>			
	·		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

Intermalial Application No
PCT/FR2004/050476

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0813088	A	17-12-1997	US EP JP	5699462 A 0813088 A1 10090735 A	16-12-1997 17-12-1997 10-04-1998
EP 1188840	Α	20-03-2002	EP	1188840 A2	20-03-2002
US 2003059807	A1	27-03-2003	WO	02099386 A2	12-12-2002
US 4803457	Α	07-02-1989	CN DE FR GB JP US	88101639 A 3806156 A1 2611402 A1 2201553 A ,B 63249301 A 4907341 A	21-09-1988 08-09-1988 02-09-1988 01-09-1988 17-10-1988 13-03-1990

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demar hternationale No PCT/FR2004/050476

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H01C1/16

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification sulvi des symboles de classement) C1B 7 C12Q G01N C12M B41J H01C G02B G02F B01L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	EP 0 813 088 A (HEWLETT-PACKARD COMPANY) 17 décembre 1997 (1997-12-17)	1,2,4-6, 8,9, 12-15, 17-19
	colonne 4, ligne 14-20,52-59 colonne 5, ligne 35-40 colonne 12, ligne 4-11 colonne 20, ligne 20-25	
X	EP 1 188 840 A (AGILENT TECHNOLOGIES, INC.) 20 mars 2002 (2002-03-20) abrégé alinéas '0016!, '0017!, '0044!, '0045!	1
	-/	
	•	

·		
	Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
	"A"-document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document anteneur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "8"	document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique perlinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention (c' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive forsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier document qui fait partie de la même famille de brevets
	Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 7 mars 2005	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 16/03/2005
***************************************	Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Fonctionnaire autorisé Dessaux, C

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Formulaire PCT/ISA/210 (suite de la deuxième feuille) (Janvier 2004)

Demar Internationale No
PCT/FR2004/050476

	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Jategorie '	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	US 2003/059807 A1 (WOLTER ANDREAS ET AL) 27 mars 2003 (2003-03-27)	1
1	alinéas '0050!, '0074!, '0077!, '0078!, '0081!; revendications 1,8,44,45; figures 7,8B le document en entier	1–22
\	US 4 803 457 A (CHAPEL JR ROY W ET AL)	1
1	7 février 1989 (1989-02-07) colonne 4, ligne 40-68; revendications 5,12	1–22

KAPPUKT DE KECHEKCHE INTEKNATIONALE

Renselgnements relatifs aux membres de familles de brevets

Demar Hernationale No
PCT/FR2004/050476

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0813088	A	17-12-1997	US EP JP	5699462 A 0813088 A1 10090735 A	16-12-1997 17-12-1997 10-04-1998
EP 1188840	Α	20-03-2002	EP	1188840 A2	20-03-2002
US 2003059807	A1	27-03-2003	WO	02099386 A2	12-12-2002
US 4803457	A	07-02-1989	CN DE FR GB JP US	88101639 A 3806156 A1 2611402 A1 2201553 A , 63249301 A 4907341 A	21-09-1988 08-09-1988 02-09-1988 01-09-1988 17-10-1988 13-03-1990